Partial English Translation

Publication Date: 2000.05.15.

5 Registration Number: 182523

Registration Date: 2000.03.07 Application Number: 1999-29728 Application Date: 1999.12.27

Utility Model Right Holder: Leeno Industrial Inc.

10

1. Title of the Device
Test prove device

15 3. Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a state diagram of a state where a test target object is tested using a conventional test prove device.

Fig. 2 is a perspective view of the probe device in $\ensuremath{\text{20}}$ Fig. 1.

Fig. 3 is a sectional view of Fig. 2.

Fig. 4 is an exploded perspective view of a test probe device according to the present device.

Fig. 5 is a partially-cut sectional view of a state 25 where a test target object is tested using the test prove device in Fig. 4.

Fig. 6 depicts another embodiment of the present device. $% \left\{ \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1$

Explanations of Reference Numerals

30 200: Probe 201: Support stage

205: Elastic spring 210: Sleeve

211: Flange 220: Test target object

Scope of Claims for Patent [Claim 1]

10

15

A test probe device comprising:

a test probe 200 formed in a bar shape, with a support stage 201 being formed therebelow;

an elastic spring 205 wound around an outside surface of the test probe 200, with the lower end thereof latched to the support stage 201; and

a test contact sleeve 210 formed in a cylindrical shape, with an upper end thereof being inserted in the test probe 200, so that the lower end of the test contact sleeve 210 comes into contact with the upper end of the elastic spring 205 and is elastically supported, wherein

the upper end of the sleeve 210 elastically comes into contact with a test contact surface of the test target object 220, to transmit electric current from the test target object 220 to the test probe 200.

[Claim 2]

The test probe device according to claim 1, wherein
the test contact sleeve 210 includes a support flange 211
at the lower end thereof, formed protruding outward along a circumferential direction, so that the support flange 211
comes into contact with the upper end of the elastic spring 205.

20-0182523

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록실용신안공보(Y1)

(51) Int. Cl. ⁷		(45) 공고일자 (11) 등록번호	2000년05월15일 20-0182523	•
GOIR 1/067				
		(24) 등록일자	2000년03월07일	
(21) 출원번호	20-1999-0029728	(65) 공개번호		
(22) 출원일자	1999년 12월 27일	(43) 공개일자		
(73) 실용신안권자	리노공업주식회사 부산광역시 시하구 장림동 831-	.1		
(72) 고만자	이채윤 부산광역시시하구장림동831-1			
(74) 대리인	구성진			
AUR - WAR				

실시를 : 점성광

(54) 검사용 탐험장치

요약

표구 만은 검사용 탐험장처에 관한 것으로서, 검사단자만의 접촉자항이 작아지도록 합으로써 검사신뢰성을 향상시킬 수 있고, 부족수가 감소되는 개선턴 구조를 설현시점으로써 제조비용을 철건시키고 조립성을 상시할 수 있도록 한 것이다. 이를 위해 검사용 탐험장자는, 버렸성으로 만들어지고 그 하부여는 지자 (20))이 형성된 검사용 탐험(200): 검사용 탐험(20)의 인표면, 성에 감기고 그 하단부가 지지역(20))에 함 접 자지도록 설계되는 탄선스프립(205)의 살린던 행상을 기지고 감사용 탐험(200)의 업무 보여 이 그 하단부가 탄선스프립(205)의 상단부에 접촉하다 탐성적으로 지지되는 검사접촉용 즐리브(210)을 포 향하며, 슬리브(210)의 상단부는 검사대상품(200)의 검사접촉만과 탄성적으로 검사접촉하여 검사대상품 (220)로부터의 전류을 검사용 탐험(200) 속으로 전달한다.

aus

55

499

반도체 칩 컨넥터 프로브 전도 단자 슬리브

gar.

도면의 권단환 설명

도 1 - 도 1은 중래의 검사용 탐험장치를 사용하며 검사대상물을 검사하는 상태를 도시한 상태도.

도 2 - 도 1의 탐침장치의 사시도.

도 3 - 도 2의 단면도.

도 4 - 본 고인에 따른 검사용 탐침장치의 분해사시도.

도 5 - 도 4의 검사용 탐험장치를 사용하여 검사대상물을 검사하는 상태를 도시한 일부절취 단면도.

도 6 - 본 고인의 다른 실시예를 보면 도면.

〈 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

200 : 탐침 201 : 지지탁

205 : 탄성스프링 210 : 슬리브

211 : 플랜지 220 : 검사대상물

DOWN AND MING

过铁의 导型

고양이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중래기술

본 고만은 검사용 탐험장치에 관한 것으로서, 검사단자와의 접촉저합이 작이지도록 합으로써 검사신뢰성을 합성시킬 수 있고, 부동수가 감소되는 개선된 구조를 설반시킴으로써 제조비용을 절감시키고 조립성을 합 상시킬 수 있는 검사용 탐험장점에 관한 것이다. 일반적으로, 진자제품 내에는 다수의 힘이 장확되어 있으며, 이를 참은 전자제품의 성능을 결정하는 중요 한 역할을 수했한다. 점은 전념을 통과시키는 고체로 이루어지는 것이 대부분이나, 최근에는 도체와 부도 제(점단제)의 중간 처항을 갖는 반도체가 많이 사용되고 있다.

반도체는 저항령미 10^{*}-10^{*}(Ωα)정도를 나타내는 것을 말한다. 반도체 접(chip)은 일반적으로 사각형상 을 갖는 용체부와 명체부의 양측으로 연중되는 복수개의 리드로 구성된다. 그래서, 리드를 통해 전기적인 신호가 몸체부 축으로 업력되기나 불력될 수 있도록 되어 있다.

미를 섭물은 각각 다양한 기능을 수행할 수 있도록 되어 있고, 전기적 선호 등이 버스를 통해 각 첩들로 전송월 수 있도록 되어 있다. 이러한 형로기관이 고밀도로 집작되어 만들어진 점이 고밀도 집작 마이크로 첩(alcro-chip)이고, 마마크로 첩은 전자제품에 장착되어 제품의 성능을 결정하는 중요한 약할을 수행한다.

따라서, 전자제품에 칩이 장확되어 전자제품이 조립완성되기 전에, 생산된 반도체 칩이 제성능을 가지는 양품인지 불량품인지를 검사해야 할 필요가 있다.

미를 수행하기 위해, 칩 테스트용 검사소켓장치가 마련되며, 반도체 칩을 검사하게 된다.

따라서, 전자용품의 마이크로 함비 청상적인 상태인지를 확인하기 위하며 검사장자에 의해 검사될 필요가 있다. 이러한 검사를 수행하기 위하며, 검사를 탐험장지(probling device)가 제용되고, 다수의 검사용 탐 청장지는 검사용 소켓장지(probling socket device)에 장작되다 사용된다.

탐험장치(105)는, 도 2에 도시된 비와 같이, 배월(barrel) 형상을 갖는 외통(111)과 외통(111) 내부에 슬 라이털 이동가능하게 설치되는 검사용 탐험(117) 등으로 구성되어 있다.

외통(III) 내부에는, 도 3에 도시된 바와 같이, 압축코밀스프립(121)이 수용되며 있고, 압축코밀스프립(121)이 상단부는 회흥(III)의 상부걸임력부(II3)에 감점시 지지되도록 되어 있다. 또한, 최로기판(IDI)과 작업 집중하게 되는 바(여가영상을 갖는 검사용 탐험(II7)이 외문(IIII) 내부에 수용되어 있고, 함당 (II7)의 상단부가 압축고밀스프립(121)의 하단부와 잡축함으로써 당첨(II7)이 탄성적으로 지지될 수 있도록 되어 있다.

이러한 구성에 의하여, 미이크로 칩(102)을 검사할 때에는, 소켓(103)의 상부에 마이크로 칩(102)를 검사 를 위해 안착시키게 되고, 소켓(103)에 섭치할 기안부(미도시)가 마이크로 칩(102)를 하방으로 가입함으로 써 마이크로 칩(102)은 탐험장치(105)의 탐험(117)과 칩촉하게 된다.

탐침(117) 하단부의 검사점부가 마이크로 칩(102)의 저면과 접촉한 상태에서 탐험(117)은 외통(111) 내부 에서 축받으로 이뤄된다. 축방으로 이격되는 탐험(117)은 압축교일스프랑((21)를 압축하면서 그루브(11 9)의 길이만큼 이동한 축에 그루브(119)의 하부축 단부양역에 외통(111)의 하부걸링력부(115)에 겁리게 됨 으로써, 이격 저지된다.

이 상태에서, 마이크로 칩(102)으로부터의 전류는, 탐험(117)의 검사성부를 통해 탐험(117)의 공체부 촉으로 호르게 되고, 탐험(117)의 그부년(119) 부분을 제외한 외표면과 면접축하는 있통(111)의 대변연을 통해 당봉(111)의 함께 출라서 고통(111) 상당부의 와이어(107)을 통해 되부로 까지나가게 된다. 그리고 있통(111)의 대변연을 통해 흐르는 전투의 일부는 압축교완스프립(121)을 통해서도 와이어(107) 축으로 호르게 된다. 따라서, 최로기관(101)와 견류가 탐험장자(105)를 통해 별도로 마련된 검사장치(미도 사)로 호르게 된다. 따라서, 최로기관(101)와 전류가 탐험장자(105)를 통해 별도로 마련된 검사장치(미도 사)로 호르게 된다.

경사를 마친 축에는, 소켓(100)의 가입부가 마이크로 접(100)을 가입해져하여, 마이크로 접(100)이 삼방으로 이동하게 된다. 그러서, 탐험(117)이 마이크로 접(100)의 저면에 있는 검사자료보다 이탈되고, 외통 [11]) 내부의 만축교립소급적 (12)의 탐전복력적에 의해 출근대당 미층하며 감사관의 위치도 복귀하다.

이렇게 수행되는 검사의 신뢰성은 탐험장치(105)를 통한 원활한 전류호등에 달려 있다. 그래서, 검사대상 물인 마이크로 참(105)과 탐험(117)의 검사접속면의 접촉점적이 얼굴추룩 흐르는 전류량이 앉아지기 때문 에, 말장 전망 하에서 집혹 사항이 작아지게 된다.

그런데, 삼기한 탐험(117)의 검사접촉 청부는 뾰족한 형상으로 이루어져 있어, 마이크로 칩(102)과의 접촉 면적이 넓지 않기 때문에, 접촉저항이 커지게 되어 검사의 신뢰성이 낮다는 문제점이 있다.

또한; 증래의 탐험장치(105)는, 외통(111), 외통(111) 내부에 설치되는 검사용 탐험(117) 및 외통(111) 내 부에서 검사용 탕험을 둘러싸는 압축코일스프링(121) 등으로 비교적 복잡하게 구성되어, 조립이 번거롭기 때문에, 조립작업성이 높지 못하다는 문제점도 있다. 그리고, 부품수가 많기 때문에 제조비용이 많이 소요된다는 단점도 있다.

고양이 이루고자 하는 기술적 **제제**

따라서 본 고인의 목적은, 상기한 문제점을 해결하기 위해 안중된 것으로서, 검사단자와의 접촉자함이 작 아지도록 함으로써 검사산뢰점을 향상시킬 수 있고, 부품수가 감소되는 개선된 구조를 실현시킴으로써 제 조비용을 철각시키고 조립성을 향상시킬 수 있는 검사용 탐험장치를 제공하는 것이다.

고안의 구성 왜 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 고안에 따른 검사을 탈혈장치는 비법상으로 만들어지고 그 하나의는 자자 탁이 행성된 3시부 달림: 3사용 달림의 말보면 속에 2기고 그 하는 무가 자자목에 걸리 기자도록 보신 는 단생스포함: 및 실립대 행성을 가지고 검사을 탐험의 상단 부성에 산업되어, 그 하단부가 탄정 사업 상단부에 집중하여 탄성적으로 자자되는 2시점을을 즐리면 보통 포함에는 즐겁만의 상단부는 당시대설을의 검사점속면과 탄성적으로 검사점을 증대적을 보안 분통 포함에는 즐겁만의 상단부 단지대설을 입 검사점속면과 탄성적으로 검사점을 하여 검사대상별로부터의 전류를 상기 검사용 탐험 속으로 전달하는 것 를 촉잡으로 받다.

여기서, 검사접촉용 슬리브는 그 하단부에 지지용 플랜지가 원주방향을 따라서 외향몰출되어 형성되고, 지 지용 플래지가 탄성스프림의 상다보아 직접 건물하다로 하는 것이 바람직하다.

이에 따라. 검사접촉용 슬리브의 상당면이 검사대상물의 검사접촉만과 곱고루 접촉함으로써, 검사단자와 의 접촉자함이 작아지게 되어 검사신뢰성이 합성된다. 그리고, 중래에 비해 검사용 탐험, 탄성스프링 및 슬리브 등으로 구성되는 간단한 구조가 구현들으로써, 제조비용이 찰감되고, 조립성이 합상될 수 있게 된 다.

이하 첨부한 도면을 참조로 하여 본 고안을 보다 상세하게 설명한다.

도 4는 보고안에 ID를 검사용 탐험장치의 분해사시도이고, 도 5는 도 4의 검사용 탐험장치를 사용하여 검사대산물을 검사하는 상태를 도시한 일부절회 단면도이다. 이를 도면에 도시된 바와 같이, 본 교 20억 따른 검사용 탐험장치는, 바법상으로 만들어지고 그 하는 바바는 저지역(201)이 현생되고 검사용 탐험(200) 검사용 탐험(200)의 외표면 상에 받기고 그 하는 바가 지지역(201)에 걸려 지지도록 생지되는 탄생스프림 (205): 웹 실린던 형상을 가지고 검사용 탐험(200)의 상단 부분에 삽입되어 그 하단부가 탄생스포림(205) 일상부에 집속하며 탄생적으로 자지되는 감사접속용 슬리브(210)로 구성된다.

검사용 탐침(200)은 원형바 형상으로 만들어져 있고, 그 하부영역에는 원형의 지지력(201)이 원형비의 회 표면으로부터 외항품출되어 형성된다.

검사용 탐험(200)의 외표면 성해 끼워져 삽입되는 탄성소프림(205)은 압축코임스프림으로 만들어져 있고, 검사용 탐험(200)의 상부명역의 거의 대부분들 댓출 수 있도록 장착된다. 그래서, 검사용 탐험(200)의 최 상단 부분만이 탄성소프림(205)에 의해 달려지지 않도록 되어 있다.

결사용 탑참(200)의 상단부에 까워지는 육리브(210)는, 내부가 비아 있는 살린더 형상으로 만들어지고, 그 하단부에는 지지용 클런지(211)가 행수방향을 따라서 외반들합되어 형성된다. 그래서, 이 지지용 (211)가 탐상-학생(200)의 성당부의 국회 청송하다록 되어 있다. 그리고, 승리브(210)의 상당부는 건사 대상물(220)의 검사점육인과 탄성적으로 검사점속하여 검사대상물(220)로부터의 검류을 검사용 탐험(200)속으로 진당함 수 있도록 되어 있다.

그래서, 김사대상물(220)로부터의 검사전류는 슬리브(210)의 성단부를 통해 슬리브(210)로 전달되고, 계속 하여 슬리브(210)와 접촉하고 있는 검사용 탐험(200)으로 흘러가서 검사용 탐험(200)의 하부에 있는 검사 장치에 전달할 수 있게 된다.

이때, 슬리브(210)의 상단부는 검사대상률(220)의 검사접촉면과 비교적 골고루 접촉되기 때문에, 접촉저항 이 중래보다는 많이 낮아지게 됨으로써, 검사의 신뢰성이 항상될 수 있게 된다.

이하 본 고안에 따른 검사용 탐험장치를 조립하는 과정을 설명하기로 한다.

상기한 검사용 탐험장치를 조립할 때에는, 먼저 검사용 탐험(200)을 검사장치에 장착하고, 탐험(200)의 길 미방향으로 단성스프링(205)를 간당하게 끼우게 된다. 그 다음, 탐험(200)의 상단 부분에 슬리브(210)를 당아 놓기만 하면 조립이 립니케 된다.

용해의 탐험장치가 배릴형상을 갖는 외통 내부에 탐험 및 탄성스프링 등을 장확하는 비교적 복잡한 조립황 정을 가치는 것에 비하여, 본 고양의 조립공정을 마추 간단하고 극히 짧은 시간 내에 조립을 꼽낼 수 있도 록 되어 있기 때문에, 조립공수가 들어들고, 조립작업성이 월등하게 항상될 수 있게 된다. 또한, 비교적 제조단가가 높은 외통이 본 고양에서는 채럭되지 않기 때문에, 제조비용이 많이 절감될 수 있게 된다.

특히, 회통(III) 외표면의 많은 지점에서, 외주방향을 (G라서 코릭(caulking)작업이 수했되어 반경방향 내 송으로 향물되는 마주 복잡하고 반겨로운 작업이 수했되어야 하기 때문에, 외통을 채택하는 것은 작업성을 저행하는 마주 큰 요인으로 작용하게 된다.

한판, 슬리브의 행상은 다양하게 변형될 수 있다. 도 6은 본 교인의 다른 실시예를 보인 도면이다. 이 도면에 도시된 바와 같이, 슬리브의 성단부가 뾰족한 형상으로 만들어지도록 함으로써, 증래에 사용하던 슬리브를 일부개조하여 사용할 수도 있다. 이는 중래에 생산된 슬리브 제조용 금행을 재활용할 수 있는 경제적 이약을 추구하는 것이다.

784 5.7

이상 설명한 비와 같이, 본 고인에 의한 검사용 탐험장치에 의하면, 검사접촉용 슬리브의 상단면이 검사대 상품의 검사접촉면과 끝고투 접촉합으로써, 검사단자와의 접촉제향이 작아지게 되며 검사신화성이 향상된 다

또한, 총래에 비해 검사용 탐험, 탄성스프링 및 슬리브 등으로 구성되는 간단한 구조가 구현됨으로써, 제 조비용이 절감되고, 조립성이 항상될 수 있게 된다.

(57) 광구의 범위

청구한 1

바형상으로 만들어지고 그 하부에는 지지력(201)이 형성된 검사용 탐침(200);

상기 검사용 탐험(200)의 외표면 상에 감기고 그 하단부가 상기 지지력(201)에 걸려 지지도록 설치되는 탄 성스프링(205): 및

실린다 형상을 가지고 상기 검사용 탐험(200)의 상단 부분에 삽입되어 그 하단부가 상기 탄성소프링(205) 의 상단부에 접촉하여 탄성적으로 지지되는 검사접촉용 슬리브(210)를 포함하여,

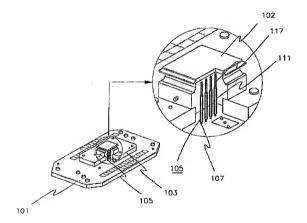
상기 즐리브(210)의 상단부는 검사대상물(220)의 검사접촉면과 탄성적으로 검사접촉하며 상기 검사대상물 (220)로부터의 전류를 상기 검사용 탐험(200) 축으로 전달하는 것을 목장으로 하는 검사용 탐험장치.

청구함 2

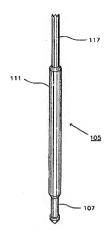
제 1항에 있어서, 상기 감사접촉용 슬러브(210)는 그 하단부에 지지용 출판지(211)가 원주방향을 따라서 외향돌을되어 형성되고, 상기 지지용 출판지(211)가 상기 탄성스프랑(205)의 상단부와 접촉하는 것을 독점 으로 하는 검사용 탐점장치,

58

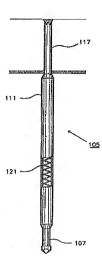
581

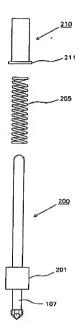




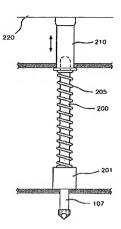


£83





585



5<u>8</u>8

